

データ登録制度の開始と料金制度改定の事前お知らせ

(データ登録制度の開始)

本年4月、ARIM(文部科学省委託事業:マテリアル先端リサーチインフラ)は、事業開始から3年目に入ります。ARIMは、第6期科学技術・イノベーション基本計画の中核を成すデータ駆動型研究の推進において、その源泉となるデータ収集の仕組みとして位置付けられています。

具体的には装置利用者の方々に、利用に伴い発生するデータ(生データ)をデータ基盤に登録して頂き、この生データをARIMが用意した計測・プロセス技術に特化したプログラムを用いて構造化します。構造化により煩わしい前処理などせず、例えば機械学習における教師データを得ることができます。このようにして得られた構造化データをARIMの利用許諾のもと、多くの研究・開発者の皆様に利用して頂くことで、データ駆動型研究の加速・発展を図る仕組みです。

ARIMではデータ登録に関する共通規定(参加機関内規のひな形)を、昨年12月に制定しました。これをベースとして令和5年度4月1日施行に向け当拠点の内規としてまとめ、学内決裁(ナノハブ拠点運営協議会)に向けて法務部門と調整中です。決裁が完了しましたら「データ登録内規」を掲載します。

(料金制度の改定)

上記のデータ登録制度の開始に伴い、利用区分を現行の公開型(利用報告書あり)／非公開型の2区分から、公開型(データ提供&利用報告書あり)／公開型(データ提供なし、利用報告書あり)／非公開型の3区分に変更します、それと共に、できるだけ多くの装置利用者の方にデータ登録して頂きたく割引率も表1に示した様に変更します。(決裁未完了のため「(案)」として示しております。)

一方で、ウクライナ情勢等の影響による原料高起因の電力料金や消耗資材費の高騰・高止まり、円安および部品不足による補修部材費の高騰・高止まり等により収支均衡を図ることが出来なくなりました。そのため誠に恐縮ですが、装置利用料金の基準料金(非公開型の利用料金=割引率0%)を表2のタイプFに示しました様に現行の1.7倍に改定させていただきます。

なお、表3に示しました様に例えば、現在もデータ提供を選択されており引き続きデータ登録(提供)を選択される方の料金変化率は、1.19倍です。また現在、非公開型を選択している大企業の方が、次回更新時に公開型(データ&利用報告書あり)を選択されますと0.95倍となります。

以上、事前のお知らせまで

【表1】R5. 4. 1からの新料金（案）（税込）

		大学・公的研究機関等の 学術研究機関の利用	企業(中小企業を除く)の 利用		中小企業の 利用		
			学術研究機関との共同研究 による利用	左記以外	学術研究機関との共同研究 による利用	左記以外	
成果公開 (利用報告書提出)	データ提供あり	装置等の利用負担金割引率 (基準料金からの割引率)	65% (アカデミック料金)	65% (アカデミック料金)	44%	65% (アカデミック料金)	65% (アカデミック料金)
		基本料金	530円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)	530円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)	840円(1装置・1時間当たり)	530円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)	530円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)
		事前講習	標準試験を用いた場合 1,540円(1時間当たり) (アカデミック料金)	1,540円(1時間当たり) (アカデミック料金)	2,460円(1時間当たり)	1,540円(1時間当たり) (アカデミック料金)	1,540円(1時間当たり) (アカデミック料金)
		それ以外	3,080円(1時間当たり) (アカデミック料金)	3,080円(1時間当たり) (アカデミック料金)	4,930円(1時間当たり)	3,080円(1時間当たり) (アカデミック料金)	3,080円(1時間当たり) (アカデミック料金)
		技術補助費	8,800円(1時間当たり)				
		技術代行費	8,800円(1時間当たり)				
	装置等の利用負担金上限	400万 (アカデミック料金)	400万 (アカデミック料金)	1,700万円	400万 (アカデミック料金)	1,700万円	
	データ提供なし	装置等の利用負担金割引率 (基準料金からの割引率)	50% (アカデミック料金)	50% (アカデミック料金)	30%	50% (アカデミック料金)	50% (アカデミック料金)
		基本料金	750円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)	750円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)	1,050円(1装置・1時間当たり)	750円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)	750円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)
		事前講習	標準試験を用いた場合 2,200円(1時間当たり) (アカデミック料金)	2,200円(1時間当たり) (アカデミック料金)	3,080円(1時間当たり)	2,200円(1時間当たり) (アカデミック料金)	2,200円(1時間当たり) (アカデミック料金)
		それ以外	4,400円(1時間当たり) (アカデミック料金)	4,400円(1時間当たり) (アカデミック料金)	6,160円(1時間当たり)	4,400円(1時間当たり) (アカデミック料金)	4,400円(1時間当たり) (アカデミック料金)
		技術補助費	8,800円(1時間当たり)				
技術代行費		8,800円(1時間当たり)					
装置等の利用負担金上限	600万 (アカデミック料金)	600万 (アカデミック料金)	1,700万円	600万 (アカデミック料金)	1,700万円		
成果非公開	装置等の利用負担金割引率 (基準料金からの割引率)		20% (準アカデミック料金)	0% (基準料金)	20% (準アカデミック料金)	0% (基準料金)	
	基本料金		1,200円(1装置・1時間当たり) (準アカデミック料金)	1,500円(1装置・1時間当たり) (基準料金)	1,200円(1装置・1時間当たり) (準アカデミック料金)	1,500円(1装置・1時間当たり) (基準料金)	
	事前講習		標準試験を用いた場合 3,520円(1時間当たり) (準アカデミック料金)	4,400円(1時間当たり) (基準料金)	3,520円(1時間当たり) (準アカデミック料金)	4,400円(1時間当たり) (基準料金)	
	それ以外		7,040円(1時間当たり) (準アカデミック料金)	8,800円(1時間当たり) (基準料金)	7,040円(1時間当たり) (準アカデミック料金)	8,800円(1時間当たり) (基準料金)	
	技術補助費	8,800円(1時間当たり)					
	技術代行費	8,800円(1時間当たり)					
	装置等の利用負担金上限		600万 (アカデミック料金)	1,700万円	600万 (アカデミック料金)	1,700万円	



現行の料金表

		大学・公的研究機関等の 学術研究機関の利用	企業(中小企業を除く)の 利用		中小企業の 利用		
			学術研究機関との共同研究による 利用	左記以外	学術研究機関との共同研究による 利用	左記以外	
成果公開 (利用報告書提出)	データ提供あり	装置等の利用負担金割引率 (基準料金からの割引率)	50% (アカデミック料金)	50%(アカデミック料金)	20%	50% (アカデミック料金)	50% (アカデミック料金)
		基本料金	500円 (1人・1時間当たり) (アカデミック料金)	500円 (1人・1時間当たり) (アカデミック料金)	800円 (1人・1時間当たり)	500円 (1人・1時間当たり) (アカデミック料金)	500円 (1人・1時間当たり) (アカデミック料金)
		事前講習	1,700円 (1時間当たり) (アカデミック料金)	1,700円 (1時間当たり) (アカデミック料金)	2,720円 (1時間当たり)	1,700円 (1時間当たり) (アカデミック料金)	1,700円 (1時間当たり) (アカデミック料金)
		技術補助費	3,400円(1時間当たり)				
		技術代行費	3,400円(1時間当たり)				
		装置等の利用負担金上限	330万円 (アカデミック料金)	330万円 (アカデミック料金)	1,430万円	330万円 (アカデミック料金)	1,430万円
	データ提供なし	装置等の利用負担金割引率 (基準料金からの割引率)	35%	35%	10%	35%	35%
		基本料金	650円 (1人・1時間当たり)	650円 (1人・1時間当たり)	900円 (1人・1時間当たり)	650円 (1人・1時間当たり)	650円 (1人・1時間当たり)
		事前講習	2,210円 (1時間当たり)	2,210円 (1時間当たり)	3,060円 (1時間当たり)	2,210円 (1時間当たり)	2,210円 (1時間当たり)
		技術補助費	3,400円(1時間当たり)				
		技術代行費	3,400円(1時間当たり)				
		装置等の利用負担金上限	330万円 (アカデミック料金)	330万円 (アカデミック料金)	1,430万円	330万円 (アカデミック料金)	1,430万円
成果非公開	装置等の利用負担金割引率 (基準料金からの割引率)		20% (準アカデミック料金)	0% (基準料金)	20% (準アカデミック料金)	0% (基準料金)	
	基本料金		800円 (1人・1時間当たり) (準アカデミック料金)	1,000円(1人・1時間当たり) (基準料金)	800円 (1人・1時間当たり) (準アカデミック料金)	1,000円(1人・1時間当たり) (基準料金)	
	事前講習		2,720円 (1時間当たり) (準アカデミック料金)	3,400円(1時間当たり) (基準料金)	2,720円 (1時間当たり) (準アカデミック料金)	3,400円(1時間当たり) (基準料金)	
	技術補助費	3,400円(1時間当たり)					
	技術代行費	3,400円(1時間当たり)					
	装置等の利用負担金上限		330万円 (アカデミック料金)	1,430万円	330万円 (アカデミック料金)	1,430万円	

【表2】装置等の利用負担金表

令和5年4月1日 改定

No.	装置等	機器名	メーカー名	利用料金(一時間当り)						設置場所
				タイプA	タイプB	タイプC	タイプD	タイプE	タイプF	
A ナノリソグラフィ装置	A01	高速高精度電子ビーム描画装置	ELIONIX/ELS-F125HS	31,680円	45,250円	50,680円	63,360円	72,410円	90,510円	イコールーム
	A02	露光装置 (ステップ)	NIKON/NSR-2205i11D	12,670円	18,110円	20,280円	25,350円	28,970円	36,210円	イコールーム
	A03	レーザー直接描画装置	Heidelberg Instruments/DWL2000	8,600円	12,280円	13,760円	17,200円	19,650円	24,570円	イコールーム
	A04	高速マスク露光装置	NanoSystem Solutions/DL-1000GS/KCH	4,880円	6,980円	7,820円	9,770円	11,170円	13,960円	イコールーム
	A05	両面マスクアライナー	SUSS MicroTec/MA6 BSA SPEC-KU/3	3,420円	4,880円	5,460円	6,830円	7,810円	9,760円	イコールーム
	A06	紫外線露光装置	MIKASA/MA-10	530円	760円	850円	1,060円	1,210円	1,510円	イコールーム
	A07	厚膜フォトリソ用スピニング装置	SUSS MicroTec/DELTA80 T3/VP SPEC-KU	1,860円	2,660円	2,980円	3,720円	4,260円	5,320円	イコールーム
	A08	レジスト塗布装置	KANAMEX/KRC-150CBU	950円	1,360円	1,520円	1,900円	2,180円	2,720円	イコールーム
	A09	スプレーコータ	Ushio/USC-2000ST	1,210円	1,730円	1,930円	2,420円	2,760円	3,450円	イコールーム
	A10	レジスト現像装置	KANAMEX/KD-150CBU	950円	1,360円	1,520円	1,900円	2,180円	2,720円	イコールーム
	A11	ウエハスピニング洗浄装置	KANAMEX/KSC-150CBU	1,770円	2,520円	2,830円	3,530円	4,040円	5,050円	イコールーム
	A12	ICP質量分析装置	Agilent Technologies/Agilent7700s	2,940円	4,200円	4,700円	5,880円	6,720円	8,400円	加工・評価室
	A13	超微細化クジェット描画装置	SIJTechnology/ST050	1,290円	1,840円	2,070円	2,580円	2,950円	3,690円	イコールーム
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	KANAMEX/KD(EB)-150CBU	1,270円	1,810円	2,030円	2,530円	2,900円	3,620円	イコールーム
	A15	大面積超高速電子線描画装置	ADVANTEST/F7000S-KYT01	41,820円	59,740円	66,910円	83,630円	95,580円	119,480円	加工評価室 (クリーンルーム)
A16	近接効果補正システム	GeniSys/BEAMER Full Package	1,100円	1,570円	1,760円	2,200円	2,520円	3,150円	サテライトオフィス	
A17	超臨界洗浄・乾燥装置	Rexam/SCRD401	730円	1,040円	1,160円	1,450円	1,660円	2,070円	イコールーム	
A18	高圧ジェットリフトオフ装置	KANAMEX/KLO-200SV1	2,400円	3,430円	3,840円	4,800円	5,480円	6,850円	イコールーム	
A53	移動マスク紫外線露光装置	Japan Science Engineering/MUM-0001	5,170円	7,390円	8,270円	10,340円	11,820円	14,770円	桂/クリーンルーム	
A54	両面マスクアライナー露光装置	Union Optical/PEM-800	810円	1,160円	1,290円	1,620円	1,850円	2,310円	桂/クリーンルーム	
B ナノ材料加工・工・製装置	B01	多元スパッタ装置 (仕様 A)	CANON ANELVA/EB-1100	4,840円	6,920円	7,750円	9,690円	11,070円	13,840円	加工・評価室
	B02	多元スパッタ装置 (仕様 B)	CANON ANELVA/EB-1100	4,610円	6,590円	7,380円	9,220円	10,540円	13,180円	加工・評価室
	B03	電子線蒸着装置	CANON ANELVA/EB-1200	3,800円	5,430円	6,080円	7,600円	8,690円	10,860円	クリーンルーム1
	B05	プラズマCVD装置	Sumitomo Precision Products/MPX-CVD	7,690円	10,990円	12,310円	15,390円	17,580円	21,980円	クリーンルーム1
	B06	集束イオンビーム走査電子顕微鏡	SHI NanoTechnology/NVision40PI	15,520円	22,170円	24,830円	31,040円	35,470円	44,340円	加工・評価室
	B07	熱酸化炉	Koyo Thermo Systems/MT-8X28-A	1,120円	1,610円	1,800円	2,250円	2,570円	3,210円	クリーンルーム2
	B09	磁気中性線放電ドライエッチング装置	ULVAC/NLD-570	6,340円	9,050円	10,140円	12,670円	14,480円	18,110円	クリーンルーム1
	B10	ドライエッチング装置	Samco/RIE-10NR-KF	1,090円	1,560円	1,740円	2,180円	2,490円	3,110円	クリーンルーム2
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	ELIONIX/EIS-1200	4,340円	6,210円	6,950円	8,690円	9,930円	12,410円	クリーンルーム2
	B12	シリコ酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	Sumitomo Precision Products/MLT-SLE-Ox	5,080円	7,250円	8,120円	10,150円	11,600円	14,500円	クリーンルーム1
	B13	シリコ犠牲層ドライエッチングシステム	Xactix/Xetch X3B	2,560円	3,660円	4,090円	5,120円	5,850円	7,310円	クリーンルーム2
	B14	赤外エムトレーザー加工装置	AVESTA PROJECT/Grf-65	4,250円	6,080円	6,810円	8,510円	9,720円	12,160円	第2加工・評価室
	B15	レーザーアニール装置	AOV/LAEX-1000	4,030円	5,760円	6,450円	8,070円	9,220円	11,530円	第2加工・評価室
	B16	紫外線ナインプリントポンドアライメント装置	SUSS MicroTec/MA/BA8 Gen3 SPEC-KU	5,420円	7,740円	8,670円	10,840円	12,390円	15,490円	イコールーム
	B17	基板接合装置	SUSS MicroTec/SB8e SPEC-KU	4,930円	7,040円	7,880円	9,850円	11,260円	14,080円	イコールーム
	B18	レーザーダイシング装置	TOKYO SEIMITSU/Mahoh Dicer ML200	8,130円	11,610円	13,000円	16,260円	18,580円	23,220円	加工・評価室
	B19	ダイシングソー	DISCO/DAD322	740円	1,050円	1,180円	1,480円	1,690円	2,110円	加工・評価室
	B20	真空マウンター	NEC/VTL-201	630円	900円	1,010円	1,260円	1,440円	1,800円	加工・評価室
	B21	紫外線照射装置	Technovision/LED-4082	280円	400円	450円	560円	640円	800円	加工・評価室
	B22	エキシマド装置	Technovision/TEX-21BG GR-5	150円	210円	240円	300円	340円	430円	加工・評価室
	B23	ウェッジワイヤボンダ	West Bond/7476D	320円	450円	500円	630円	720円	900円	第2加工・評価室
	B24	ボールワイヤボンダ	West Bond/7700D	330円	470円	520円	650円	750円	940円	第2加工・評価室
	B25	ダイボンダ	West Bond/7200CR	290円	420円	470円	580円	670円	830円	第2加工・評価室
	B26	ナインプリントシステム	OBUDUCAT/Eitre3	1,290円	1,840円	2,070円	2,580円	2,950円	3,690円	イコールーム
	B27	赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	MORITEX/1rise-T	1,220円	1,740円	1,950円	2,440円	2,790円	3,490円	イコールーム
	B28	電子線蒸着装置 (2)	Osaka Vacuum/OVE-350	490円	700円	780円	980円	1,120円	1,390円	第2加工・評価室
B29	高性能ツフル炉	AS ONE/HPM-2N	50円	80円	90円	110円	120円	150円	第2加工・評価室	
B30	UVオゾンクリーナー・キュア装置	Samco/UV-300HKU	670円	960円	1,080円	1,340円	1,540円	1,920円	クリーンルーム2	
B31	水蒸気プラズマクリーナー	Samco/AQ-500KU	1,090円	1,560円	1,740円	2,180円	2,490円	3,110円	クリーンルーム2	
B32	真空蒸着装置	SANVAC/RD-1400	750円	1,070円	1,200円	1,500円	1,710円	2,140円	加工・評価室	
B33	深堀りドライエッチング装置	Samco/RIE-800IPB-KU	6,320円	9,030円	10,110円	12,640円	14,440円	18,050円	クリーンルーム1	
B36	誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング装置	ULVAC/Gemini-200E	6,840円	9,770円	10,940円	13,670円	15,630円	19,530円	クリーンルーム1	
B37	赤外線ランプ加熱装置	ADVANCE RIKO/RT P-6	410円	590円	660円	820円	940円	1,170円	加工・評価室	
B51	バルン成膜装置	Specialty Coating Systems/PDS-2010	430円	610円	690円	860円	980円	1,220円	桂/クリーンルーム	
B52	ICP-RIE装置	ULVAC/NE-730	600円	860円	960円	1,200円	1,370円	1,720円	桂/クリーンルーム	
B53	簡易RIE装置	Samco/FA-1	390円	550円	620円	770円	880円	1,110円	桂/クリーンルーム	
B54	ウエハ接合装置	Bondtech/WAP-100	5,470円	7,810円	8,750円	10,940円	12,500円	15,620円	桂/クリーンルーム	
B55	ナインプリント装置	MARUNI/TP-32937	210円	310円	340円	430円	490円	610円	桂/クリーンルーム	
B56	ダイシング装置	DISCO/DAD322	690円	990円	1,100円	1,380円	1,580円	1,970円	桂/化学処理室	

【表2の続き】装置等の利用負担金表

令和5年4月1日 改定

No.	機器名	メーカー名	利用料金(一時間当り)						設置場所
			タイプA	タイプB	タイプC	タイプD	タイプE	タイプF	
C01	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	Hitachi High-Technologies/SU8000	5,780円	8,260円	9,250円	11,570円	13,220円	16,520円	加工・評価室
C02	分析走査電子顕微鏡	Hitachi High-Technologies/SU6600	8,060円	11,510円	12,890円	16,110円	18,410円	23,020円	加工・評価室
C03	高速液中原子間力顕微鏡	RIBM/NanoLiveVision NLV-KS	3,080円	4,390円	4,920円	6,150円	7,030円	8,790円	設備サポート拠点
C04	走査型プローブ顕微鏡システム	JPK Instruments/NanoWizard III	2,800円	4,000円	4,470円	5,590円	6,390円	7,990円	第2加工・評価室
C05	共焦点レーザ走査型顕微鏡	Olympus/FV1000	3,000円	4,280円	4,800円	6,000円	6,850円	8,570円	第2加工・評価室
C06	3D測定レーザ顕微鏡	Olympus/OLS4000-SAT	1,200円	1,720円	1,920円	2,400円	2,750円	3,430円	加工・評価室
C08	全反射励起蛍光イメージングシステム	Olympus/	2,450円	3,500円	3,920円	4,900円	5,600円	7,000円	設備サポート拠点
C09	長時間撮影蛍光イメージングシステム	Olympus/IX81-ZDC2	1,860円	2,660円	2,980円	3,720円	4,260円	5,320円	設備サポート拠点
C10	X線回折装置	Rigaku/SmartLab	3,260円	4,660円	5,220円	6,520円	7,450円	9,320円	加工・評価室
C11	分光エリブメーター	Otsuka Electronics/FE-5000	1,990円	2,840円	3,180円	3,970円	4,540円	5,680円	クリーンルーム2
C12	光ピンセットシステム	JPK Instruments/NanoTracker	2,350円	3,360円	3,760円	4,700円	5,370円	6,720円	設備サポート拠点
C13	ゼータ電位・粒径測定システム	Otsuka Electronics/ELSZ-2Plus	1,290円	1,840円	2,060円	2,570円	2,940円	3,670円	第2加工・評価室
C14	ダイナミック光散乱光度計	Otsuka Electronics/DLS-8000DH	1,710円	2,450円	2,740円	3,430円	3,920円	4,900円	第2加工・評価室
C16	マイクロシステムアナライザ	Polytec/MSA-500-TPM2-20-D	3,390円	4,850円	5,430円	6,780円	7,750円	9,690円	加工・評価室
C17	(プローブ)	MICRONICS/Model 708ft	760円	1,080円	1,210円	1,510円	1,730円	2,160円	加工・評価室
C18	(真空プローブ)	Cascade Microtech/PLV50	2,960円	4,220円	4,730円	5,910円	6,760円	8,450円	加工・評価室
C19	パワーバイスタアナライザ+ (C17プローブ)	Agilent Technologies/B1505A	960円	1,370円	1,530円	1,920円	2,190円	2,740円	加工・評価室
C20	インピーダンスアナライザ+ (C18真空プローブ)	Agilent Technologies/4294A	400円	570円	640円	800円	910円	1,140円	加工・評価室
C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	NEOARK/MLD-230D-200K	1,270円	1,810円	2,030円	2,530円	2,900円	3,620円	第2加工・評価室
C22	超微小材料機械変形評価装置	ELIONIX/ENT-2100	1,270円	1,810円	2,030円	2,530円	2,900円	3,620円	第2加工・評価室
C24	セルテストシステム	Solartron Analytical	1,260円	1,790円	2,010円	2,510円	2,870円	3,590円	第2加工・評価室
C25	卓上顕微鏡(SEM)	Hitachi High-Technologies/TM3000	470円	670円	750円	940円	1,070円	1,340円	クリーンルーム1
C26	高周波伝送特性測定装置 (C27+C28+C29)	APOLLOWAVE/a150	420円	600円	680円	840円	970円	1,210円	加工・評価室
C27	(RFプローブキット)	Cascade Microtech/ZPROBE	170円	250円	280円	350円	390円	490円	加工・評価室
C28	(ネットワークアナライザ)	ROHDE&SCHWARZ/ZVB14	430円	610円	690円	860円	980円	1,220円	加工・評価室
C29	(半導体パラメータアナライザ)	Keithley Instruments/4200-SCS	420円	600円	680円	840円	970円	1,210円	加工・評価室
C30	強誘電体特性評価システム	TOYO/FCE-3	860円	1,230円	1,380円	1,730円	1,970円	2,470円	加工・評価室
C31	接触式シート抵抗測定器	NAPSON/Cresbox	370円	530円	590円	740円	840円	1,050円	加工・評価室
C32	触針式段差計	Veeco Instruments/Dektak150	550円	790円	890円	1,110円	1,260円	1,580円	クリーンルーム2
C33			加工・評価室						
C34	ウエハロファイラ	KLA/Zeta-388	6,520円	9,310円	10,420円	13,030円	14,890円	18,620円	クリーンルーム2
C51	光干渉膜厚計	FILMETRICS/F20	290円	420円	470円	580円	670円	830円	桂/化学処理室

備考

1 上記表中の利用料は以下の利用タイプに区分された1時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、これに当該機器の利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

・タイプA：学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用、中小企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用（標準利用負担金（タイプF）の額の35%を10円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプB：学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用、中小企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用（標準利用負担金（タイプF）の額の50%を10円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプC：中小企業を除く企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用（標準利用負担金（タイプF）の額の56%を10円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプD：中小企業を除く企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用（標準利用負担金（タイプF）の額の70%を10円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプE：ARIM事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用（標準利用負担金（タイプF）の額の80%を10円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプF：ARIM事業に基づかない企業の単独利用

注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

2 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

3 複数の機器を利用する場合には、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

4 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。

5 中小企業とは中小企業基本法第2条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

【表3】利用料金変化率			
利用者属性	利用条件		利用料金 変化率
	改定前(R4年度)	改定後(R5年度)	
大企業	データ提供有り	データ提供有り	119%
	公開(データ提供無し)	公開(データ提供無し)	132%
	公開(データ提供無し)	データ提供有り	106%
	非公開	公開(データ提供無し)	119%
	非公開	データ提供有り	85%
	非公開	非公開	170%
中小企業	データ提供有り	データ提供有り	119%
	公開(データ提供無し)	公開(データ提供無し)	131%
	公開(データ提供無し)	データ提供有り	92%
	非公開	公開(データ提供無し)	85%
	非公開	データ提供有り	60%
	非公開	非公開	170%
アカデミア	データ提供有り	データ提供有り	119%
	公開(データ提供無し)	公開(データ提供無し)	131%
	公開(データ提供無し)	データ提供有り	92%
アカデミア と共同研究 する企業	データ提供有り	データ提供有り	119%
	公開(データ提供無し)	公開(データ提供無し)	131%
	公開(データ提供無し)	データ提供有り	92%
	非公開	公開(データ提供無し)	106%
	非公開	データ提供有り	74%
	非公開	非公開	170%

- ①データ提供を続けると、119%
- ②公開(データ提供無し)を続けると、約131%
- ③公開(データ提供無し)⇒データ提供有りで、92%~106%
- ④非公開⇒データ提供で、60%~95%
- ⑤非公開⇒公開(データ提供無し)で、85%~119%
- ⑥非公開を続けると、170%

